IEC 62047-5
(First edition – 2011)

Semiconductor devices –
Micro-electromechanical devices –

Part 5: RF MEMS switches

CEI 62047-5
(Première édition – 2011)

Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs microélectromécaniques –

Partie 5: Commutateurs MEMS-RF

CORRIGENDUM 1

3.3.1
electro-statically actuated switch

Replace “moving contact” *by* “moving plate” *in the definition.*

3.3.4
piezo-electrically actuated switch

Add the word “plate” *between* “movable” *and* “constructed” *in the definition*

5.2.2.3 Principle of measurement

Renumber the first equation in this subclause as follows:

$R_{on} = re\ (Z_{on})$ (1)

and renumber the existing Equations (3) to (11) of this publication accordingly.

5.2.4.4 Measurement procedure

Replace “Equation (6)*” by* “Equation (5)” *in the last paragraph of this subclause.*

5.3.3.4 Measurement procedure

Replace “the Equations (10) and (11)*” by* “the Equations (9) and (10)” *in the first paragraph of this subclause.*

6.2.3 Hot switching or power handling

*Replace “*Figure 5*” by “*Figure 6*” in the third sentence of this subclause.*

3.3.1
commutateur actionné par voie électrostatique

Remplacer «un contact mobile» *par* «une plaque mobile» *dans la définition.*

3.3.4
commutateur actionné par voie piézoélectrique

La correction ne concerne que le texte anglais.

5.2.2.3 Principe de mesure

Renuméroter la première équation de ce paragraphe comme suit:

$R_{on} = re\ (Z_{on})$ (1)

et renuméroter les Equations (3) à (11) existantes de la publication en conséquence.

5.2.4.4 Procédure de mesure

*Remplacer «*l’Equation (6)» *par «*l’Equation (5)» *dans le dernier alinéa de ce paragraphe.*

5.3.3.4 Procédure de mesure

*Remplacer «*les Equations (10) et (11)» *par «*les Equations (9) et (10)» *dans le premier alinéa de ce paragraphe.*

6.2.3 Commutation chaude ou puissance supportée

Remplacer «La Figure 5» *par* «La Figure 6» *dans la troisième phrase de ce paragraphe.*